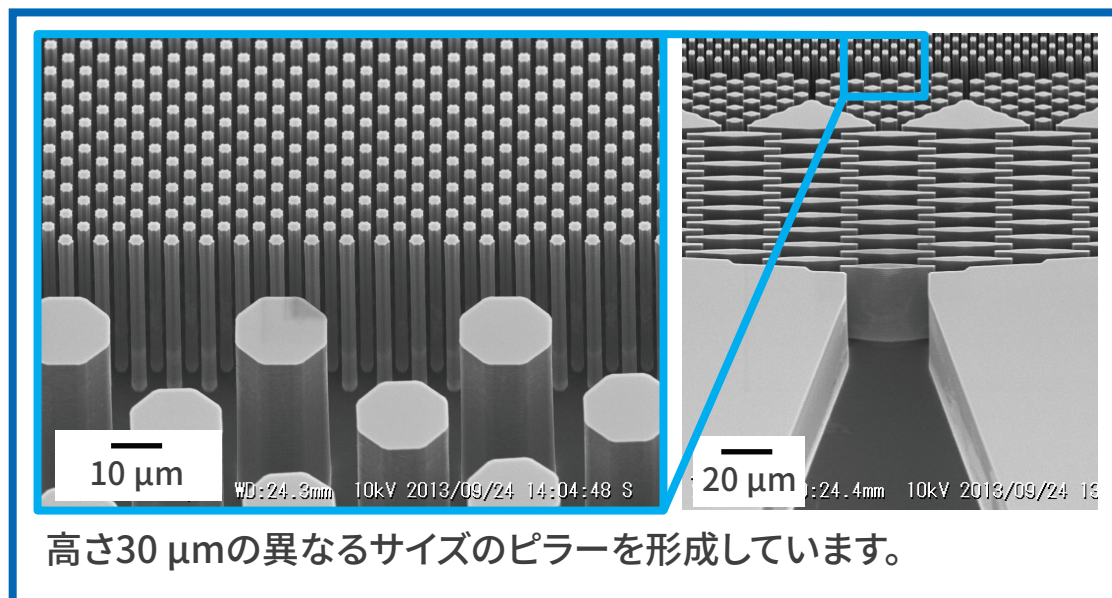


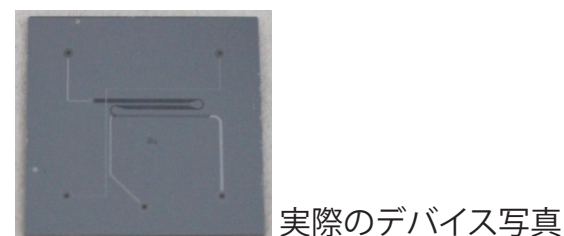
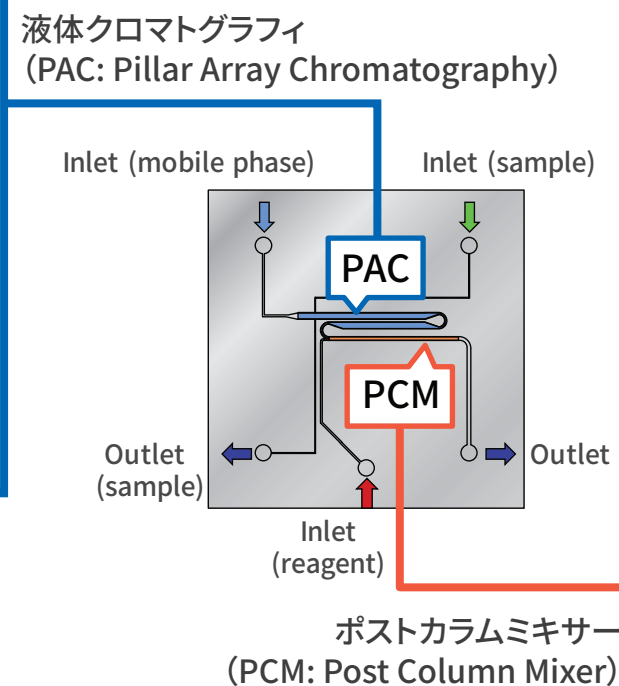
MEMS

国内外の大学や企業・研究機関との
協力関係を築き、薄膜技術を用いて
デバイス進化に貢献

液体クロマトグラフィとポストカラムミキサーの作製



最大4インチウエハ対応の
R&D用Si深掘り装置
RIE-400iPB



早稲田大学 電子物理システム学科 庄子研究室 ご提供

